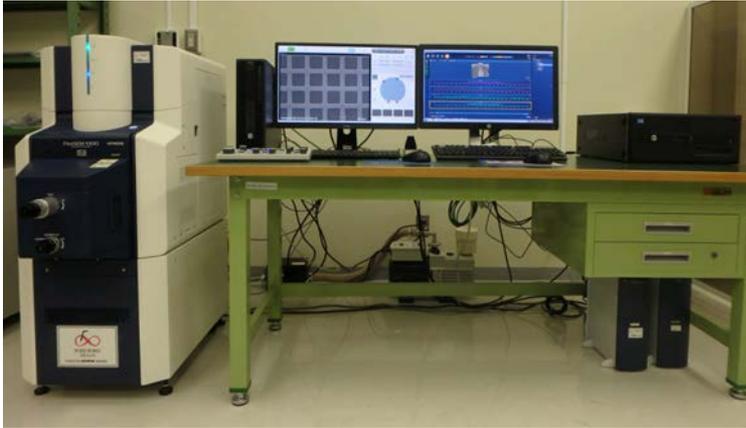


# 八戸工業研究所所有装置

名称	走査型電子顕微鏡	メーカー	(株)日立 ハイテクノロジーズ	型式	FlexSEM1000	取得	H28
概要	人間の目では約0.1mmまで見えますが、この装置ではミリメートルからナノメートルまでの表面観察ができます。さらに、エネルギー分散型エックス線分析装置により、観察と同時に表面の元素も調べることができます。						
応用事例	異物分析、破面観察など						
主な仕様	フィラメント:W(タンゲステン)フィラメント 加速電圧:0.3 kV~20 kV 分解能:4.0nm(二次電子像、加速電圧:20 kV、高真空モード)、5.0nm(反射電子像、加速電圧:20 kV、低真空モード) 倍率(*通常使用:1万倍程度) × 6~ × 300,000 (写真倍率) × 16~ × 800,000 (モニター表示倍率) 低真空設定:6~100Pa 試料サイズ:φ 64mm H40mm まで エネルギー分散型エックス線分析装置(EDS):シリコンドリフト検出器、B~U、ポイント及びマップ分析						
測定時間	30分~		 				
出力形態	JPG形式 ファイル						
試料等の制約	* 試料室が真空(低真空)となるため、試料室を汚染するおそれのある試料は観察をできません。事前にご確認ください。						
使用料 手数料	依頼試験: 走査電子顕微鏡による観察 14,150 円/件(写真5枚まで)、6枚目以降1枚ごとに 2,350 円/枚、 エネルギー分散型エックス線分析装置による分析(定性) 17,150 円(1試料1ヶ所目)、 1ヶ所を超える測定の場合1ヶ所ごとに 5,900 円						
お問い合わせ 八戸工業研究所 技術支援部 TEL: 0178-21-2100, FAX: 0178-21-2101 e-mail: <a href="mailto:kou_hachinohe@aomori-itc.or.jp">kou_hachinohe@aomori-itc.or.jp</a>							